

2026창의융합형공학인재양성지원사업

반도체 · 디스플레이 기술교육



I 개요

1. 운영 기간: 2026. 7. 13.(월) ~ 7. 16.(목)
 - [1분반] 2026. 7. 13.(월) ~ 7. 14.(화)
 - [2분반] 2026. 7. 15.(수) ~ 7. 16.(목)
2. 주최/주관: 호서대학교 공학교육혁신센터, 호서대학교 차세대디스플레이혁신융합사업단, 호서대학교 RISE 사업단, 공주대학교 교육혁신센터
3. 대상: 총 2개 대학 32명(각 분반별 16명)
4. 장소: 호서대학교 아산캠퍼스 벤처산학협력관 101호/103호(클린룸)
5. 교육과정 운영방식 및 주요 내용
 - 호서대학교 교내 클린룸 교육장 활용으로 실습 위주 기술교육 단기과정 운영
 - 디스플레이 공정 실습과 유사 산업분야 반도체 공정 실습을 융합하여 교육 내용으로 구성
 - 학부 재학생을 대상으로 기초, 심화 2개의 교육과정 구성

구분	대상	교육 주제
1분반(기초)	학부재학생 전 학년 총 16명	디스플레이 기초 및 포토공정 차세대 디스플레이 소자 공정실습
2분반(심화)	학부재학생 3~4학년 총 16명	반도체·디스플레이 8대 공정 기초 및 측정/평가 실습

- 세부 교육 내용

구분	일시/시간	교육내용	강사	
1분반	7월 13일 1일차 (8H)	09:00 ~ 09:20	■ 인사말 및 사진촬영	• 문승재 교수
		09:20 ~ 12:00	■ 교육소개 및 디스플레이 기초 및 공정이론	
		12:00 ~ 13:00	■ 점심시간	
		13:00 ~ 18:00	■ 포토리소 공정 실습 (2개조로 나눠서 진행) - 세정, 감광액도포, 경화, 노광, 현상, 박리	• 문승재 교수 • 보조강사 2명
1분반	7월 14일 2일차 (7H)	10:00 ~ 12:00	■ 용액 공정 실습 (2개조로 나눠서 진행) - 용액 합성, 교반, 표면처리, 후처리 공정	• 문승재 교수 • 보조강사 2명
		12:00 ~ 13:00	■ 점심시간	
		13:00 ~ 18:00	■ 소자 측정/분석 (2개조로 나눠서 진행) - 소자 전기적 측정법, 소자 정량/정성 분석	• 문승재 교수 • 보조강사 2명
2분반	7월 15일 1일차	09:00 ~ 09:20	■ 인사말 및 사진촬영	• 문승재 교수

구분	일시/시간		교육내용	강사
	(8H)	09:20 ~ 12:00	■ 교육소개 및 반도체 8대 공정 기초	
		12:00 ~ 13:00	■ 점심시간	
		13:00 ~ 18:00	■ 포토리소 공정 실습 (2개조로 나눠서 진행) - 세정, 감광액도포, 경화, 노광, 현상, 박리	• 문승재 교수 • 보조강사 2명
	7월 16일 2일차 (7H)	10:00 ~ 12:00	■ 진공 공정장비 실습 Sputter, Thermal evaporation, PECVD, ALD, RIE - 장비구조, 동작원리, 증착실습	• 문승재 교수 • 보조강사 2명
		12:00 ~ 13:00	■ 점심시간	
		13:00 ~ 15:00	■ 반도체 패키징 기술 - 공정 기술 및 장비	• 문승재 교수
15:00 ~ 18:00		■ 측정 및 분석 - I/V 특성, 현미경 표면분석, SEM	• 문승재 교수 • 보조강사 2명	

※ 세부 일정은 사정에 따라 일부 변경될 수 있음

II 추진 일정

1. 세부 추진 일정

일정	운영 내용	비고
2026. 5. 19.(화) ~ 6. 19.(금)	교육과정 참가학생 모집	대학별 개별모집 및 선정
2026. 6. 22.(월) ~ 7. 8.(수)	대학별 교육과정 참가학생 선정 및 교육 참가안내	참가학생 개별 연락
2026. 7. 13.(월) ~ 7. 14.(화)	교육과정 운영 - 1분반	
2025. 7. 15.(수) ~ 7. 16.(목)	교육과정 운영 - 2분반	